

模擬スス粒子発生器

- ✓ DPF/GPFへのローディング
- ✓ 各種センサー開発のための評価・試験用
- ✓ 粒子数計測器などの点検用
- ✓ エアフィルタ/キャビンフィルタ性能試験用

DPF/GPFローディング

各種触媒へのローディングを、エンジンベンチを使用せず省スペースで行うことができます。また、発生された模擬スス粒子は、粒径を可変することができるため、さまざまなエンジンタイプのエンジン排ガスに対応しています。

各種センサー開発用

OBDセンサー用PMセンサーや各種センサーの開発において、省スペースで安定した模擬スス粒子を発生させることは、開発スピードの向上につながります。

弊社で提案している発生器は、大容量発生タイプから卓上型まで取り揃えており、お客様のニーズに合った機器を提案します。

粒子数計測器点検用

粒子数計測器などの日常的な検査用に粒子発生器として使用できます。

中心径が10nmのような小粒径を発生可能な発生器などもご用意しております。

エアフィルタ/キャビンフィルタ性能試験用

エアフィルタやキャビンフィルタなどの性能評価用模擬スス粒子発生装置としてご使用いただけます。発生装置だけではなくダクトなどを含めた試験設備としてのご相談にもお受けいたします。



PALAS社 DNP digital 3000

□仕様

- ・発生粒子径（平均径）
約30~60nm
- ・個数濃度
~10⁷particles/cm³
- ・発生ガス流量
窒素ガス：約4~20L/min
装置内希釈エア：約0~50L/min
- ・キャリアガス：窒素ガス



Jing Ltd Mini CAST E/C series

□仕様

- ・発生粒子径（平均径）
10~200nm
- ・個数濃度
~10⁸particles/cm³
- ・発生ガス流量
6301E:ca.12L/min
5301E:ca.30L/min
5303E:ca.120L/min
5304E:ca.200L/min



TESTO社 REXS

□仕様

- ・発生粒子径（平均径）
65,80,110nm
(オプションで30~120nm任意のサイズを
選択可能)
- ・発生質量濃度
最大約2.3g/h
- ・発生ガス流量
約600~700L/min